【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公表番号】特表2000-516094(P2000-516094A)
【公表日】平成12年12月5日(2000.12.5)
【出願番号】特願平10-510051
【国際特許分類第７版】
　Ｃ１２Ｎ　15/09
　Ｃ１２Ｑ　 1/68
【ＦＩ】
　Ｃ１２Ｎ　15/00　　ＺＮＡＡ
　Ｃ１２Ｑ　 1/68　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成16年7月23日(2004.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】補正の内容のとおり
【補正方法】変更
【補正の内容】

通

手 続 補 正 書

平成１６年7月２３日

特許庁長官 殿

１．事件の表示　　平成１０年特許願第５１００５１号

２．補正をする者

名　　称　　アボット・ラボラトリーズ

３．代 理 人　　東京都新宿区新宿１丁目１番１１号 友泉新宿御苑ビル
(郵便番号 160-0022) 電話 (03)3354-8623
(6200)　弁理士　川 口 義 雄

４．補正命令の日付　　自 発

５．補正により増加する請求項の数　　なし

６．補正対象書類名　　明細書

７．補正対象項目名　　明細書

８．補正の内容

（１）明細書中、発明の名称を「試験試料から増幅阻害物を除去する方法」と補正する。